

8장. 根軌跡 (Root Locus) 기법

선형계통에서, 임의의 Parameter가 변할 때 특성방정식의 根軌跡을 조사하여 계의 특성을 파악한다.

특성방정식을 $F(s) = 0$ 라 하면

$$F(s) = P(s) + KQ(s) = 0$$

여기서 P 는 s 의 n 차 다항식, Q 는 s 의 m 차 다항식이다

또, K 는 實定數로 $-\infty$ 에서 ∞ 까지 변화한다.

K 의 값에 따라

1. 근궤적 (RL ; Root Locus)
 $\Rightarrow 0 \leq K < \infty$ 인 경우의 근궤적
2. 對應 근궤적 (CRL ; Counter Root Locus)
 $\Rightarrow -\infty < K \leq 0$ 인 경우의 근궤적
3. 근 카운터 (RC ; Root Counter)
 \Rightarrow 한 개 이상의 파라미터가 변할 때 근궤적
4. 완전 근궤적
 $\Rightarrow -\infty < K < \infty$ 에서의 근궤적

8.2. 근궤적의 기본 성질

폐루프계의 전달함수

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

특성방정식 : $1 + G(s)H(s) = 0 \rightarrow A$

여기서 $G(s)H(s)$ 가 K 를 가진다고 하자

$$G(s)H(s) = \frac{KQ(s)}{P(s)}$$

그러면 특성방정식은

$$1 + \frac{KQ(s)}{P(s)} = \frac{P(s) + KQ(s)}{P(s)} = 0$$

$$\therefore \underline{P(s) + KQ(s) = 0}$$

만일 $G(s)H(s) = KG_1(s)H_1(s)$ 로 표기하면, A 에 대입하여

$$G_1(s)H_1(s) = -1/K$$

이 방정식이 만족되기 위해서 다음 조건들이 동시에 성립하여야 한다.

① 크기 조건 : $|G_1(s)H_1(s)| = 1/|K| \quad (-\infty < K < \infty)$

② 각도 조건 : $\angle G_1(s)H_1(s) = (2k+1)\pi \quad (k \geq 0)$

($= \pi$ 의 홀수배)

$$\angle G_1(s)H_1(s) = 2k\pi \quad (k \leq 0)$$

($= \pi$ 의 우수배)

만일 $G(s)H(s)$ 가 m 개의 0점과 n 개의 극점을 가지면

$$G(s)H(s) = K \cdot \frac{(s+z_1)(s+z_2)\dots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\dots(s+p_n)}$$

이고

$$|G_1(s)H_1(s)| = \frac{\prod_{i=1}^m |s+z_i|}{\prod_{j=1}^n |s+p_j|} = \frac{1}{|k|} \quad (-\infty < k < \infty)$$

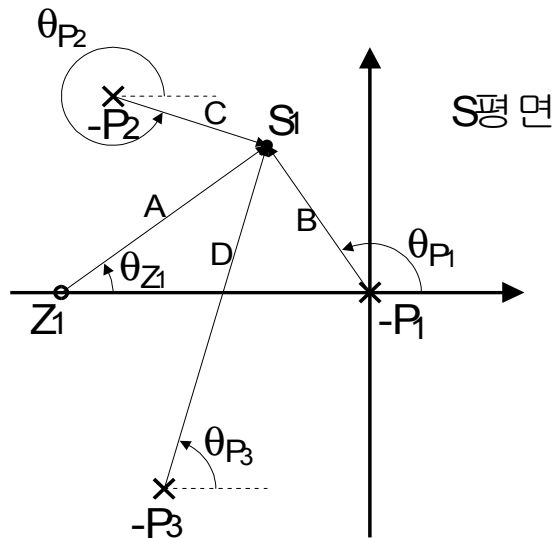
$$\begin{aligned} \angle G_1(s)H_1(s) &= \sum_{i=1}^m \angle(s+z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s+p_j) \\ &= (2k+1)\pi \quad (0 \leq K \leq \infty) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \angle G_1(s)H_1(s) &= \sum_{i=1}^m \angle(s+z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s+p_j) \\ &= 2k\pi \quad (-\infty < K \leq 0) \end{aligned}$$

또는

$$|k| = \frac{\prod_{j=1}^n |s+p_j|}{\prod_{i=1}^m |s+z_i|} \quad \left(\prod_{j=1}^n : \text{각 요소의 곱을 의미} \right)$$

(ex) $G_1(s)H_1(s) = \frac{K(s+z_1)}{s(s+p_2)(s+p_3)}$ 이라면,



s평면내 임의의 점 s_1 을 선정하여 $G(s)H(s)$ 의 극과 영점에서 s_1 으로 vector를 그린다. 그러면

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \angle(s_1 + z_1) - \angle(s_1 + p_2) - \angle(s_1 + p_3) \\ & = \theta_{z_1} - \theta_{p_1} - \theta_{p_2} - \theta_{p_3} = (2k+1)\pi \\ & \hspace{15em} (\text{\textit{s}}_1 \text{이 RL 상에 있을 때}) \\ & = 2k\pi \hspace{15em} (\text{\textit{s}}_1 \text{이 CRL 상에 있을 때}) \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad |K| = \frac{|s_1| |s_1 + p_2| |s_1 + p_3|}{|s_1 + z_1|} = \frac{BCD}{A}$$

에 의해 근궤적상의 점 s_1 에서 k의 크기를 구할 수 있다.

③ 최근에는 디지털 컴퓨터를 이용 효과적으로 근궤적을 간단히 그릴 수 있게되었다.

8.3. 완전 근궤적의 작도

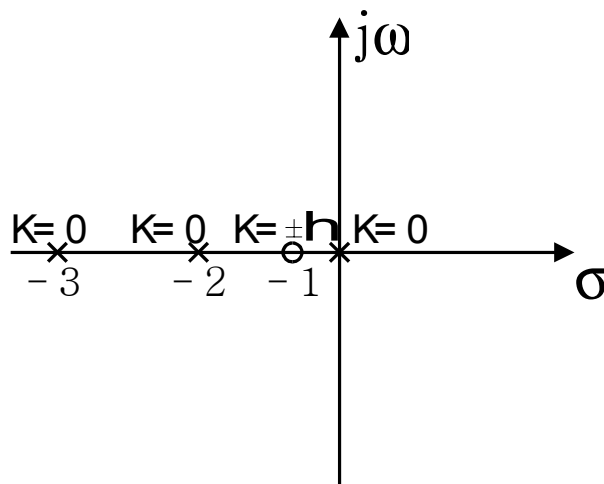
- ① $K = 0$ 인 점 : 완전 근궤적 上의 $K = 0$ 인 점은 $G(s)h(s)$ 의 극점이다.

$$|G_1(s)H_1(s)| = 1 / |K|$$

- ② $K = \pm\infty$ 인 점 : 완전 근궤적 上의 $K = \pm\infty$ 인 점은 $G(s)H(s)$ 의 영점이다.

(ex) $S(S+2)(S+3) + K(S+1) = 0$

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K(S+1)}{S(S+2)(S+3)} = 0$$

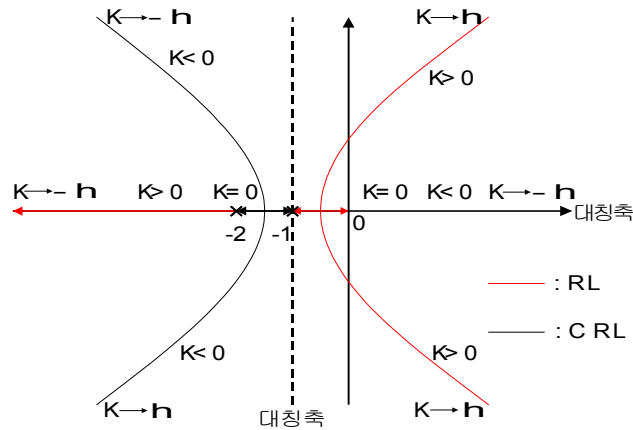


- ③ 완전 근궤적의 기로의 수 ; 근궤적의 기로의 수는 다항식(특정방정식)의 차수와 같다.

- ④ 완전 근궤적은 실수축에 대해 대칭이다.
일반적으로 근궤적은 $G(s)H(s)$ 의 극점과 영점의 대칭축에 대하여 대칭이다.

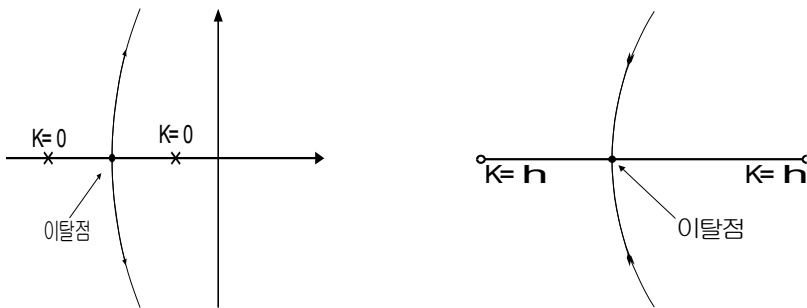
(ex) $S(S+1)(S+2) + K = 0$

$$G(s)H(s) = \frac{K}{S(S+1)(S+2)}$$

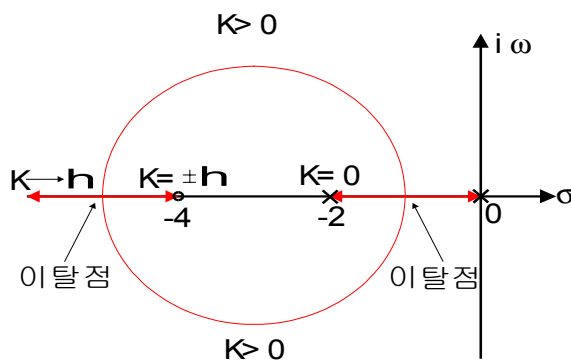


⑤ 완전 근궤적 上의 離脫点 (鞍裝点 : saddle point)

: 어떤 방정식의 근궤적 上 이탈점 혹은 안장점은 그 방정식의 다중근에 대응한다.



(ex) $G_1(s)H_1(s) = \frac{(S+4)}{S(S+2)}$



* 근의 감도 (root sensitivity)

: k가 변할 때 특성방정식의 근의 감도

$$S_k = \frac{ds/s}{dk/k} = \frac{k}{s} \frac{ds}{dk}$$

이탈점에서 근의 감도는 ∞ 이다.

따라서 이탈점에서 동작하는 k값을 선택하지 않아야 한다.

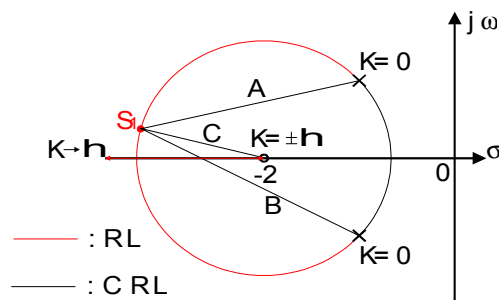
이상적으로는, 제어계의 어떤 parameter 변화에 계가 민감하지 않아야 한다.

즉 예를 들어 어떤 계가 임의의 전방이득 k에 대해 만족스럽게 작동하더라도, 이 계가 k 변화에 너무 민감하다면, k가 조금만 변해도 이 계는 불안정해지거나, 불필요한 동작영역으로 바뀐다.

계의 파라미터 변화에 민감하지 않는 계를 강인(強靱: Robust) 계통이라 한다.

* 근 궤적 위에서 k 구하기

$$(ex) s^2 + 2s + 2 + k(s+2) = 0 \quad 1 + \frac{k(s+2)}{(s^2 + 2s + 2)} = 0$$



RL 上의 점 s_1 에서의 k는 $K = AB / C$ 로 구해진다.

$$\text{또 } s=0 \text{ 점에서 k는 } K = -\frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{2} = -1$$

8.4. 극과 영점의 첨가

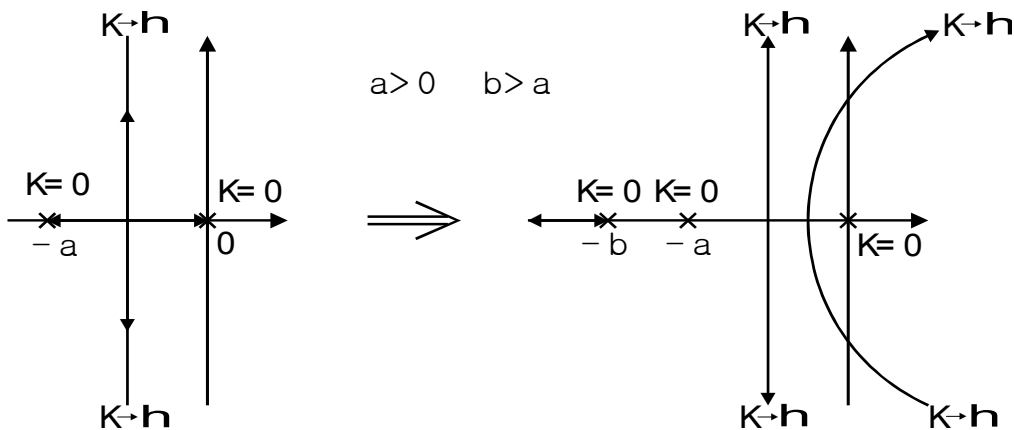
루프전달함수 $G(s)H(s)$ 에, s 평면 좌반면극을 첨가시키면 근궤적을 우반면쪽으로 이동시키는 효과를 갖는다.

$G(s)H(s)$ 에 좌반면 영점을 첨가시키면 근궤적을 좌반면 쪽으로 이동시키고, 또 좌반면 쪽으로 휘게 하는 효과가 있다.

그러면 상대 안정도는 개선된다.

$$G(s)H(s) = \frac{k}{s(s+a)}$$

$$\Rightarrow G(s)H(s) = \frac{k}{s} (s+a)(s+b)$$



극의 첨가로 인한 효과